

ICP 発光分光分析装置 SPS3520UV

製造元	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) 購入年度：2011 年度
仕様	高周波電源部…周波数：27.12 MHz、出力：0.6 ～ 1.6 kW 測光方式…動径方向 分光部…ツェルニ・ターナー型分光器（波長範囲：130 ～ 850 nm） 検出部…光電子増倍管
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・7 階 727 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	標準試料及び未知試料の前処理と装置利用後の廃液処理は利用者が行うこと。 廃液回収用の 500mL ポリ瓶と脱イオン交換水又は純水 1 L を測定の都度持ち込むこと。
連絡先	材料工学専攻 技術職員 宇野優衣 075-753-5434 uno.yui.4u@kyoto-u.ac.jp
キーワード	ICP-OES、定量分析、ppm オーダー、Ar プラズマ
機器コード	0000103010
自由記入欄	液体試料を霧状にして Ar プラズマ内に導入し、Ar プラズマの熱により試料がイオン化・原子化し、励起状態になる。基底状態に戻る際に放出した光の波長と強度により、試料の定量分析を行う。ppm オーダーの分析が可能である。

令和6年10月10日現在

